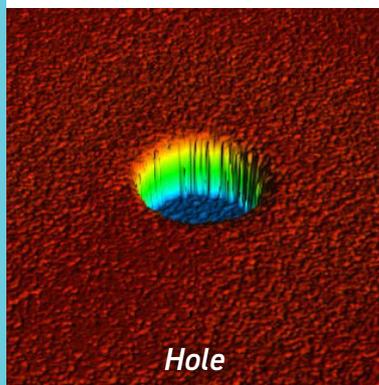
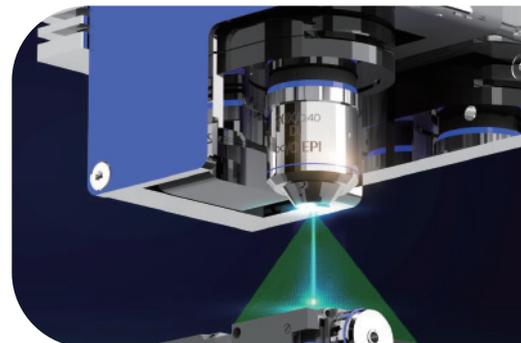
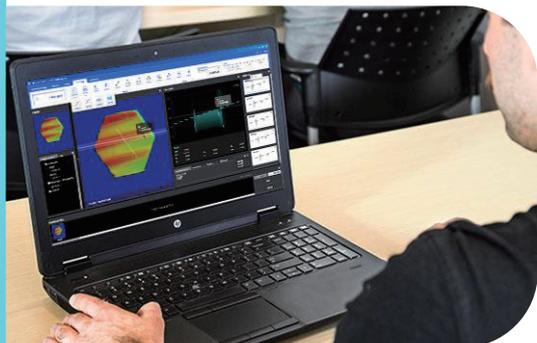


nXI-5

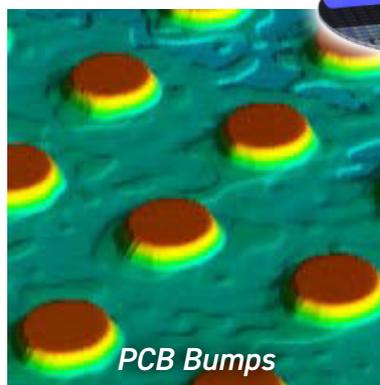
nexensor

3D 白色干渉顕微鏡・変位計

高速にサブマイクロスケールの構造を把握



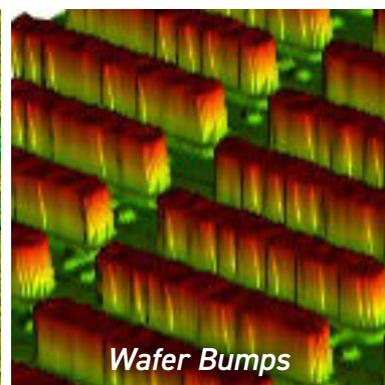
Hole



PCB Bumps



Roughness



Wafer Bumps

- 1秒以下の測定時間
- 1回のスキャンで表面と膜の下の構造を測定
- 段差・幅・角度・体積・粗さ・平坦度などの測定
- 顕微鏡タイプ、タレットタイプ

Nexensor社のnXI-5はサブマイクロスケールの領域の表面構造を精度よく高速に測定する3D白色干渉顕微鏡・変位計です。1秒以下の測定時間で段差、幅、角度、粗さ、平坦度など様々な測定が可能です。1 μ m薄膜の分離が可能で、1度のスキャンで表面と膜の下の構造を測定できます。

センサの制御には、組み込みインライン用に対応するインタフェースが提供され、オフラインでの三次元計測・解析用には、付属するアプリケーションソフトウェアNX-SCANをお使いいただけます。

ARGO corporation

仕様

※お客様サンプルのデモ測定をご希望の場合はお気軽にご相談ください。

システム	測定原理	3 D 白色干渉・変位計測技術			
	スキャンタイプ	エリアスキャン			
	スキャンレンジ	100 / 400 / 800 μ m			
	垂直分解能	0.5 / 2 / 4nm			
	繰返精度	30nm			
	スキャン時間	<1 秒			
	サイズ	331 × 182 × 109mm / 331 × 213 × 183mm			
	重量	<6 kg (Z軸モーター含まず)			
	HWインターフェース	CXP			
	SWインターフェース	TCPI/IP			
三次元測定及び解析ソフトウェア		NX-SCANソフトウェア			
光学系	レンズ倍率	10x	20x	50x	100x
	計測エリア	0.96 × 0.96mm	0.48 × 0.48mm	0.192 × 0.192mm	0.096 × 0.096mm
	WD	7.4mm	4.7mm	3.4mm	2 mm
	ピクセル分解能	1 μ m	0.5 μ m	0.2 μ m	0.1 μ m
	NA	0.3	0.4	0.55	0.7
オプション オートフォーカス	レンジ	\pm 200 μ m			
	時間	<0.5s			

システムタイプ
(型番)標準
nXI-5タレット
nXI-5Tコンパクト
nXI-5C

nXScan / nXView

 付属ソフトウェア

製品付属の nXScan・nXView はそれぞれ計測用・解析用の専用ソフトウェアです。

計測面のライブビュー表示や計測設定の変更が簡単に行え、特定箇所の段差・幅・角度・体積・粗さ・平坦度などが直感的な操作で確認できます。

